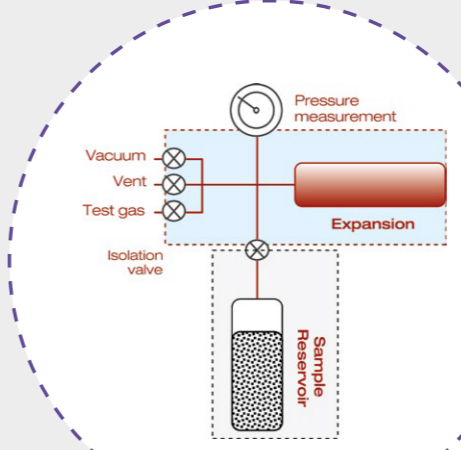




- **宽广的温度范围可匹配各种不同的应用**
从-260℃至500℃
- **多种操作模式**
等温吸附，动力学和循环寿命，压力可至200 bar
- **微量样品测量**
Microdoser选项 (专利号: US8132476)
- **在线联用扩展**
能够与量热仪进行在线同步联用，直接测量热流，表征气固反应强度

基本参数	GASPRO
温度范围(°C)	-260°C ~ 500 °C 更高温度可定制
标定缓冲池	标定缓冲池，体积从5mL-1.2L
测试气体类型	CO ₂ , CH ₄ , N ₂ , Ar, H ₂ , He...
安全性	可燃气体报警装置，紧急泄爆口
压力	
操作压力范围	真空~200 bar 压力调节：自动的PID压力控制 恒定P, ΔP 或 f(ΔP)
压力控制(调节)	2个压力传感器 (真空~200 bar)
样品室压力测量	1个高压传感器 (真空~200 bar) 1个低压传感器 (真空~5 bar) 精度：1% R.
灵敏度	3 μ mole (配置Microdoser)



GASPRO基于5个缓冲池 (已标定)，可控温度和压力。

测试气体通过一个复杂的压力控制单元以所需的压力输入到缓冲池，然后注入样品腔。

提供15种自动化操作程序，包括：

- 压力-组分等温线 (PCT,PCI)；
- 动力学和速率常数与压力和温度之间的关系；
- 循环动力学和循环PCT测量；

GASPRO特别适用于气-固吸附反应 (粉末、块状、薄膜)，也适用于部分气液吸附反应。

GASPRO样品池采用外挂式设计，方便连接各种体积和温度范围的样品池。

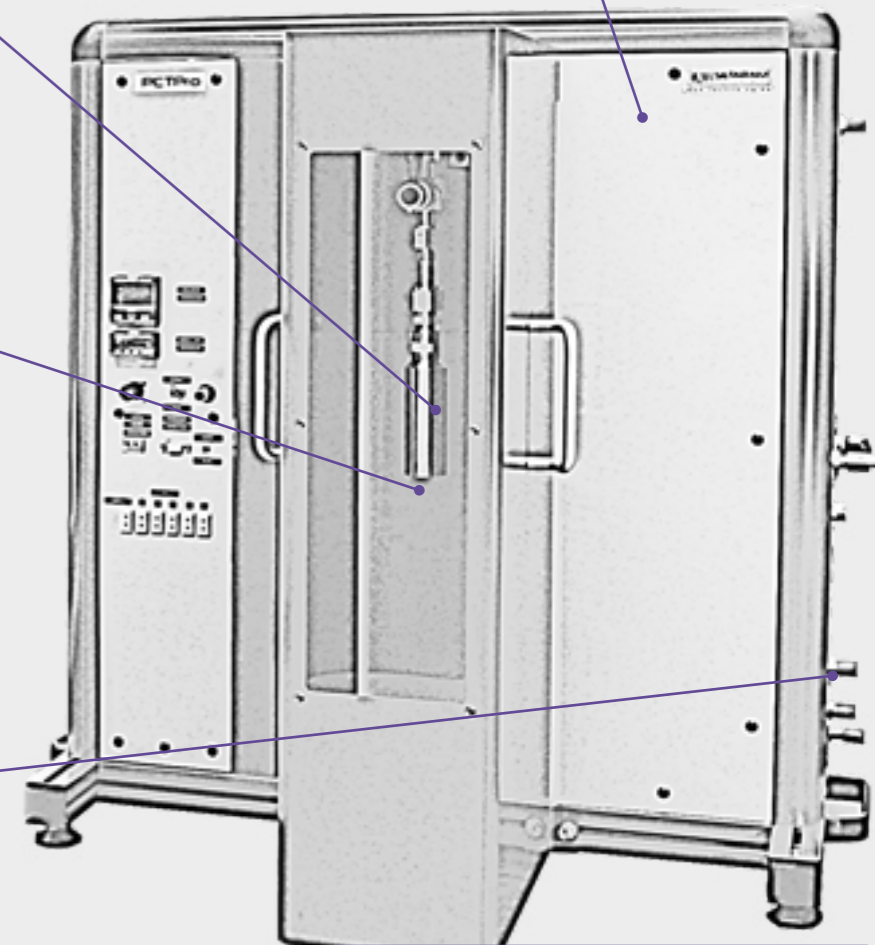
此种设计便于与其它设备进行在线同步联用，如量热仪。

独一无二的Microdoser选项，使得低于100mg样品测试成为可能。

高温至500 °C(更高需要定制)；
低温至-260 °C(可满足各种需求)。

气体&真空连接
(测试气体接口，气动阀气路，排气口，真空泵，氮气气路，安全泄压口)。

均设计在主机侧面，便于工程师安装和维护。



GASPRO剖面示意图